# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

### **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

# IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-134394

(43)Date of publication of application : 22.05.1998

(51)Int.CI.

(21)Application number : 08-281925

(71)Applicant : TDK CORP

(22)Date of filing:

24.10.1996

(72)Inventor: HIROSE KAZUNORI

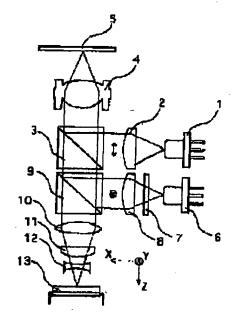
**OKA SADAICHIROU** 

### (54) OPTICAL PICKUP DEVICE AND ITS ADJUSTING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To miniaturize the device at a low cost by receiving two light beams outputted from two light sources by one photodetector.

SOLUTION: When a laser diode 1 is turned on, since its light beam is already set to be incident upon a polarizing beam splitter 3 as a P wave, about 50% of the light beam is reflected to form a spot on a recording surface of an optical recording medium 5. This light beam is reflected by the recording surface of the recording medium 5, and is incident upon the beam splitter 3 as the P wave. About 50% of this light beam is transmitted through the beam splitter 3 and is transmitted through a polarizing beam splitter 9 about 100%, and is then incident upon the photodetector 13, so that a focusing error signal FE and a tracking error signal TE are obtained. Then, when a laser diode 6 is turned on, its beam as an S wave is reflected by the recording surface of the optical recording medium 5, and is incident upon the photodetector 13 to obtain the focusing error signal FE and the tracing error signal TE accordingly.



### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

21.08.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]
[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

### (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

### 特開平10-134394

(43)公開日 平成10年(1998) 5月22日

(51) Int.Cl.6

識別記号

G11B 7/135

FΙ

G11B 7/135

Α

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特顏平8-281925

(22)出願日

平成8年(1996)10月24日

(71)出願人 000003067

ティーディーケイ株式会社

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

(72)発明者 広瀬 一則

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

ディーケイ株式会社内

(72)発明者 岡 禎一郎

東京都中央区日本橋一丁目13番1号ティー

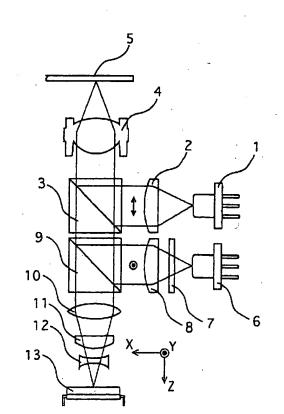
ディーケイ株式会社内

### (54) 【発明の名称】 光学ピックアップ装置及びその調整方法

#### (57)【要約】

【課題】 2つの光源から出力される光ピームを1つの 光検出器で受光するようにし、光学ピックアップ装置の 小型化及び低コスト化を図ること。

【解決手段】 第1の光ビームを出力する第1の光源と、第2の光ビームを出力する第2の光源と、前記第1の光ビーム及び第2の光ピームを同じ光検出器に導く光学系を有する光学ピックアップ装置の光学系の調整方法であって、前記第1の光源と光検出器との位置関係を設定した後に、該第1の光源と光検出器との位置関係を保持した状態で、上記第2の光源と光検出器との位置関係を設定することを特徴とする光学ピックアップ装置の調整方法。



2

#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 第1の光ビームを出力する第1の光源と、第2の光ビームを出力する第2の光源と、前記第1の光ビーム及び第2の光ビームを同じ光検出器に導く光学系を有する光学ピックアップ装置の光学系の調整方法であって、前記第1の光源と光検出器との位置関係を設定した後に、該第1の光源と光検出器との位置関係を保持した状態で、上記第2の光源と光検出器との位置関係を保持した状態で、上記第2の光源と光検出器との位置関係を設定することを特徴とする光学ピックアップ装置の調整方法。

【請求項2】 請求項1記載の光学ピックアップ装置の調整方法に於いて、上記第2の光源を、該第2の光源が出力する第2の光ピームの光軸に垂直な面内でのみ位置調整し、前記光検出器と第2の光源との、第2の光ピームの光軸方向の位置調整は、光学レンズを第2の光ピームの光軸方向で位置調整することにより行うことを特徴とする光学ピックアップ装置の調整方法。

【請求項3】 請求項1記載の光学ピックアップ装置の 調整方法に於いて、上記第2の光源を、該第2の光源が 出力する第2の光ピームの光軸方向でのみ位置調整し、 前記光検出器と第2の光源との、第2の光ピームの光軸 に垂直な面内での位置調整は、光学レンズを第2の光ピームの光 ームの光軸に垂直な面内で位置調整することにより行う ことを特徴とする光学ピックアップ装置の調整方法。

【請求項4】 請求項1乃至3記載のいずれかの光学ピックアップ装置の調整方法を用いて光学系を調整した光学ピックアップ装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は光学ピックアップ装 30 置に係り、特に、複数の光源を有する光学ピックアップ 装置及びその調整方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、光記録媒体の応用範囲の広範化に伴い、記録密度、基板(保護層)の厚み、基板(保護層)の材質、記録再生方式、ディスクサイズ等が異なる多種の光記録媒体が、提供されている。

【0003】そして、これらの記録密度が異なる光記録 媒体を取り扱う光学ピックアップ装置に於いては、光記 録媒体の記録密度に応じて光ピームのスポット(集光ス 40 ポット)の径(以下、スポット径という。)を変化させ る必要がある。

【0004】ここで、上記記録密度は、記録マーク長とトラックピッチによって規定されるが、最短記録マーク長が $0.8\mu$ m程度の低密度記録媒体の場合には、スポットの径を $1.4\mu$ m程度の大きさに、最短記録マーク長が $0.4\mu$ m程度の高密度記録媒体の場合には、スポットの径を $0.9\mu$ m程度の大きさにする必要がある。【0005】又、スポット径Dは、次式で与えられる。

 $[0\ 0\ 0\ 6]\ D = k \cdot \lambda / NA$ 

ここで、kは光束の強度分布や収差等によって決まる比例定数であり、λは光ピームの波長である。尚、比例定数は、通常は、

k = 0. 82

としている。

【0007】又、NAはレンズの開口数であり、次式で与えられる。

[0008]  $NA=n \times sin \theta$ 

この式で、n は屈折率であり、 $\theta$  は図9(レンズ6 1の 10 開口数を説明するための説明図)に示したように射出瞳 , 径に張る角度である。

【0009】これらの式からもわかるように、スポット 径Dを小さくするためには、光ピームの波長 $\lambda$ を短くすることや、レンズの開口数(NA)、つまり $\theta$ を大きくすることが必要となる。

【0010】又、レンズの開口数(NA)を大きくしたときにコマ収差が大きくなるのを抑えるため、一般的に記録媒体(光ディスク)の基板(保護層)の厚さを薄くする。この様に、基板(保護層)の厚さを変えた場合には、基板(保護層)で発生する球面収差も変化するため、基板(保護層)の厚さ毎に異なる収差補正を施さなければならない。

【0011】このような記録密度や基板(保護層)の厚さが異なる記録媒体を記録再生するために、波長の異なる光ピームを出力する複数の光源を設けた光学ピックアップ装置が幾つか提案されている。

【0012】例えば、特開平6-259804号公報に示されている光学ピックアップ装置は、CD用半導体レーザと蒋型ディスク用半導体レーザという2光源を有し、それぞれの光源に対応して、CD用光検出器、薄型ディスク用光検出器が設けられている。

【0013】この光学ピックアップ装置では、CD用半導体レーザから出力された光ピームは光ディスクで反射され、その後、CD用光検出器で受光される。又、薄型ディスク用半導体レーザから出力された光ピームは光ディスクで反射され、その後、薄型ディスク用光検出器で受光される。つまり、この光学ピックアップ装置では、光ディスクの基板の種類に応じて、光源と光検出器が2組設けられていた。

0 [0014]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のように光源毎に受光素子(光検出器)を設けた場合、光学ピックアップ装置が大型化し、組立調整にかかる時間も長くなり、又、部品点数の増加により製品コストも高くなる。

【0015】そこで、本発明は、2つの光源から出力される光ピームを1つの光検出器で受光するようにし、装置の小型化及び低コスト化を図った光学ピックアップ装置及びその調整方法を提供することを目的とする。

50 [0016]

【課題を解決するための手段】請求項1記載の光学ピックアップ装置の調整方法は、第1の光ピームを出力する第1の光源と、第2の光ピームを出力する第2の光源と、前記第1の光ピーム及び第2の光ピームを同じ光検出器に導く光学系を有する光学ピックアップ装置の光学系の調整方法であって、前記第1の光源と光検出器との位置関係を設定した後に、該第1の光源と光検出器との位置関係を保持した状態で、上記第2の光源と光検出器との位置関係を設定することを特徴とするものである。

【0017】請求項2記載の光学ピックアップ装置の調整方法は、請求項1記載の光学ピックアップ装置の調整方法に於いて、上記第2の光源を、該第2の光源が出力する第2の光ビームの光軸に垂直な面内でのみ位置調整し、前記光検出器と第2の光源との、第2の光ビームの光軸方向の位置調整は、光学レンズを第2の光ビームの光軸方向で位置調整することにより行うことを特徴とするものである。

【0018】請求項3記載の光学ピックアップ装置の調整方法は、請求項1記載の光学ピックアップ装置の調整方法に於いて、上記第2の光源を、該第2の光源が出力20 する第2の光ビームの光軸方向でのみ位置調整し、前記光検出器と第2の光源との、第2の光ビームの光軸に垂直な面内での位置調整は、光学レンズを第2の光ビームの光軸に垂直な面内で位置調整することにより行うことを特徴とするものである。

【0019】請求項4記載の光学ピックアップ装置は、 請求項1乃至3記載のいずれかの光学ピックアップ装置 の調整方法を用いて光学系を調整したものである。

[0020]

#### 【発明の実施の形態】

[光学ピックアップ装置の構成について] 本発明にかかる光学ピックアップ装置の構成を図面を参照して説明する。

【0021】図1は、本発明にかかる光学ピックアップ 装置の光学系を示したものである。この光学ピックアップ装置は、2つの光源を有し、レーザダイオード1は波長650nmの光ピームを出力し、レーザダイオード6は波長780nmの光ピームを出力する。又、これらの光源から出力された光ピームは、いずれも光検出器13で受光される。

【0022】上記光源から出力された光ビームが受光素子13に達するまでを、レーザダイオード1を点灯させた場合と、レーザダイオード6を点灯させた場合とに分けて説明する。

【0023】まず、レーザダイオード1を点灯させた場合、出力された光ピームは、コリメータレンズ2で発散光から平行光にされ、偏光ピームスプリッタ3に入射する。この偏光ピームスプリッタ3の透過特性は、図2

(a) に示したように設定され、レーザダイオード1から出力された光ピームは、 偏光ピームスプリッタ 2 に P 50

波として入射するように設定されているため、偏光ビームスプリッタ3に入射した光ピームのうち約50%が反射(図2(a)p1)され、この反射された光ピームが対物レンズ4に入射する。対物レンズ4に入射した光ピームは、平行光から収束光にされ、光記録媒体5の記録面にスポットを形成する。

【0024】この光ピームは、光記録媒体5の記録面で 反射され対物レンズ1に入射する。対物レンズ1に入射 した光ピームは、発散光から平行光にされ、偏光ピーム スプリッタ3にP波として入射する。偏光ピームスプリ ッタ3に入射した光ピームのうち約50%が透過(図2 (a) p1) し、この透過した光ビームが、偏光ビーム スプリッタ9にP波として入射する。この偏光ピームス ブリッタ9の透過特性は、図2(b)に示したように設 定されているため、偏光ピームスプリッタ9に入射した 光ピームは約100%が透過(図2(b)p3)し、集 光レンズ10に入射する。集光レンズ10に入射した光 ピームは平行光から収束光にされアナモフィックレンズ 11に入射する。アナモフィックレンズ11に入射した 光ピームは、フォーカシングのための非点収差が与えら れ、凹レンズ12を介して光検出器13の受光面に入射 する。

【0025】ここで光検出器13の受光面には、受光素子21、22、23が設けられており、受光素子22は、a、b、c、dに4分割されている。レーザダイオード1を点灯させた場合には、上記光ビームは、受光素子22上に集光する(図3(b))。又、フォーカシング方法として非点収差法、トラッキング方法としてブッシュブル法を用いている。

30 【0026】従って、受光素子22のa、b、c、dで変換された信号出力(a、b、c、dで変換された信号出力を、A(a)、A(b)、A(c)、A(d)とする)を下記のように演算することにより、フォーカシングエラー信号FE及びトラッキングエラー信号TEが求められる。

[0027] FE = (A(a) + A(d)) - (A(b) + A(c))

TE = (A (a) + A (b)) - (A (c) + A (d))

40 次に、レーザダイオード6を点灯させた場合、出力された光ビームは、回折格子7で3ビームに分離され、コリメータレンズ8に入射する。コリメータレンズ8に入射した光ビームは、発散光から平行光にされ、偏光ビームスブリッタ9に入射する。レーザダイオード6から出力された光ビームは、偏光ビームスブリッタ9に入射した光ビームのうち約50%が反射(図2(b)p4)され、この反射された光ビームが偏光ビームスブリッタ3にS波として入射する。偏光ビームスプリッタ3にS波として入射する。偏光ビームスプリッタ3にS波として入射する。偏光ビームスプリッタ3にS波として入射する。

2 (a) p 2) し、対物レンズ4に入射する。

【0028】対物レンズ4に入射した光ピームは、平行 光から収束光にされ、光記録媒体5の記録面にスポット を形成する。

【0029】この光ピームは、光記録媒体5の記録面で 反射され対物レンズ1に入射する。対物レンズ1に入射 した光ビームは、発散光から平行光にされ、偏光ビーム スプリッタ3にS波として入射する。偏光ビームスプリ ッタ3に入射した光ビームのうち約100%が透過(図 ムスプリッタ9にS波として入射する。偏光ピームスプ リッタ9に入射した光ピームは約50%が透過(図2 (b) p4) し、集光レンズ10に入射する。集光レン ズ10に入射した光ピームは平行光から収束光にされア ナモフィックレンズ11に入射する。アナモフィックレ ンズ11に入射した光ピームは、フォーカシングのため の非点収差が与えられ、凹レンズ12を介して光検出器 13の受光面に入射する。

【0030】ここでレーザダイオード6を点灯させた場 合には、上記光ビームは、光検出器13の受光素子2 1、22、23上に集光する(図3(c))。又、フォ ーカシング方法として非点収差法、トラッキング方法と して3ピーム法を用いている。

【0031】従って、受光素子21、23で変換された 信号出力(受光素子21、23で変換された信号出力 を、A(1)、A(3)とする)及び受光素子22の a、b、c、dで変換された信号出力(a、b、c、d で変換された信号出力を、A(a)、A(b)、A (c)、A(d)とする)を下記のように演算すること により、フォーカシングエラー信号FE及びトラッキン グエラー信号TEが求められる。

[0032] FE = (A (a) + A (d)) - (A(b) + A(c)

TE = A (1) - A (3)

[光学系の調整方法について] 以上のように、図1に示 したレーザダイオード1を点灯させた場合とレーザダイ オード6を点灯させた場合に、共に適正なフォーカシン グエラー信号FE及びトラッキングエラー信号TEを得 るためには、レーザダイオード1、レーザダイオード6 及び光検出器13を適切な位置に配置する必要がある。 次に、本発明にかかる光学ピックアップ装置の光学系の 調整方法について図1を参照して説明する。

【0033】本発明の光学ピックアップ装置では、次の ようにしてレーザダイオード1、レーザダイオード6及 び光検出器13の位置を設定している。

【0034】まず、レーザダイオード1を点灯させた状 態で、凹レンズ12をレーザダイオード1が出力する光 ピームの光軸方向(2軸方向)で位置調整し、光検出器 13を光ビームの光軸に垂直な面内(X、Y軸方向)で 位置調整し、光ピームを光給出毀13トの適切が位置に

集光させる。ここで、凹レンズ12による位置調整を行 わずに、又は、凹レンズ12を用いずに(凹レンズ12 を削除する)、光検出器13をX、Y、2軸方向で位置 調整してもよいが、凹レンズ12により位置調整を行え ば、より容易にレーザダイオード1と光検出器13の位 置関係を調整することができる。又、集光レンズ11を 位置調整することにより、レーザダイオード1と光検出 器13の位置関係を調整してもよい。

【0035】次に、レーザダイオード6を点灯させた状 2 (a) p 2) し、この透過した光ビームが、偏光ビー 10 態で、レーザダイオード 6 を位置調整 (X、Y、Z 軸方 向)し、回折格子7をレーザダイオード6が出力する光 ピームの光軸方向を軸として回転調整することにより、 光ピームを光検出器13上の適切な位置に集光させる。 ここで、コリメータレンズ8をレーザダイオード6が出 力する光ピームの光軸方向(X軸方向)で位置調整し、 レーザダイオード6を光ピームの光軸に垂直な面内 (Y、 Z 軸方向) で位置調整してもよい。

> 【0036】尚、上記の場合、レーザダイオード6を使 用する場合に、トラッキング方法として3ピーム法を用 20 いているため、回折格子7をレーザダイオード6が出力 する光ビームの光軸方向を軸として回転調整したが、ト ラッキング方法としてブッシュブル法を用いれば、回折 格子7が不要となり、その回転調整も不要となる。

【0037】又、上記でレーザダイオード1と光検出器 13の位置関係を調整するときに、光検出器13を動か さずに、レーザダイオード1やコリメータレンズ2を動 かすことにより位置調整してもよい。

【0038】又、上記でレーザダイオード6と光検出器 13の位置関係を調整するときに、コリメータレンズ8 をレーザダイオード 6 が出力する光ピームの光軸に垂直 な面内(Y、Z軸方向)で位置調整し、レーザダイオー ド6を光ビームの光軸方向(X軸方向)で位置調整して

【0039】 [光検出器について] 又、光検出器13の 受光素子の感度は、図4に示したように波長依存性を有 するため、異なる波長の光ピームを出力する光源で、同 一の受光素子を共用する場合には、感度に差異が生じる が、その差異は電気回路で調整することができる。

【0040】又、図5に示したように、同一の受光素子 40 を異なる波長の光ピームを出力する光源で共用せずに、 レーザダイオード1用に受光素子24を設け、レーザダ イオード6用に受光素子25、26、27を別々に設け てもよい。

【0041】 [有限系で構成した光学ピックアップ装置 について] 本発明は、図6に示したような有限系の光学 ピックアップ装置の場合にも同様に適用することができ る。この光学ピックアップ装置は、波長650nmの光 ピームを出力するレーザダイオード31と、波長780 nmの光ピームを出力するレーザダイオード35を有

てわたの単語がと川上をかもかい

8で受光される。

【0042】又、この光学ピックアップ装置は、有限系 で構成されているため、コリメータレンズが削除されて いる。更に、この光学ピックアップ装置では、いずれの 光源の場合も、フォーカシング方法として非点収差法、 トラッキング方法としてブッシュブル法を用いているの で、回折格子が用いられていない。光検出器38につい ても、2つの光源で同一の受光素子を共用すれば、4分 割された1つの受光素子を設けるだけでよい。

をアナモフィックレンズ、その反対側の面を凹レンズに した複合レンズ37を用いることにより、光学系の簡素 化を図っている。

【0044】又、偏光ピームスプリッタ32の透過特性 は図2(a)、偏光ピームスプリッタ36の透過特性は 図2(b)に示したように設定されている。従って、光 学系に於ける効率は、図1に示した無限系の光学ピック アップ装置の場合とほぼ同じになる。

【0045】尚、この光学ピックアップ装置の場合も、 図1に示した無限系の光学ピックアップ装置の場合とほ 20 び偏光ピームスプリッタ43に入射するが、波長650 ぼ同様の方法で光学系の調整することができる。

【0046】つまり、レーザダイオード31を点灯させ た状態で、複合レンズ37を光軸方向(2軸方向)で位 置調整し、光検出器38を光軸に垂直な面内(X、Y軸 方向)で位置調整し、光ピームを光検出器38上の適切 な位置に集光させる。ここで、複合レンズ37による位 置調整を行わずに、光検出器38をX、Y、2軸方向で 位置調整してもよい。

【0047】次に、レーザダイオード35を点灯させた 状態で、レーザダイオード35を位置調整 (X、Y、Z 30 軸方向) し、光ピームを光検出器13上の適切な位置に 集光させる。

【0048】「光学系に於ける効率を改善した光学ピッ クアップ装置について] 図7は、図1に示した無限系の 光学ピックアップ装置とほぼ同様の光学ピックアップで あるが、偏光ビームスプリッタ43と対物レンズ45の 間に1/4波長板44が挿入されている。この1/4波 長板44は、レーザダイオード41から出力される波長 650nmの光ビーム(直線偏光)が透過するときに円 **偏光になるように設定されているため、レーザダイオー ^40** ド47から出力される波長780mmの光ビーム(直線 偏光)が透過した場合には楕円偏光になる。

【0049】又、偏光ピームスプリッタ43の透過特性 は図8(a)、偏光ピームスブリッタ49の透過特性は 図8(b)に示したように設定されている。

【0050】又、いずれの光源の場合も、フォーカシン グ方法として非点収差法、トラッキング方法としてブッ シュブル法を用いているので、回折格子が用いられてい ない。

【0051】この光学ピックアップ装置では レーザダ 50 成を示した鉛田図である

イオード41から出力された光ビームは、偏光ビームス

ブリッタ43にS波として入射し約100%(図8 (a) p1) の光ピームが、対物レンズ45側に反射さ れる。この光ピームは、光記録媒体46の記録面で反射 され再び偏光ピームスプリッタ43に入射するが、1/ 4波長板44を2度透過しているため偏光面が90°回 転し、P波として入射する。従って、この光ピームは、 約100%(図8(a)p2)が偏光ピームスプリッタ 43を透過し、偏光ピームスプリッタ49にP波として 【0043】又、この光学ピックアップ装置では、片面 10 入射する。 偏光ビームスブリッタ49にP波として入射 した光ピームは、約100% (図8 (b) p4) が透過

> 【0052】一方、レーザダイオード47から出力され た光ビームは、偏光ビームスプリッタ49にS波として 入射し約100% (図8 (b) p5) の光ピームが反射 され、偏光ピームスプリッタ43にS波として入射す る。偏光ピームスプリッタ43にS波として入射した光 ピームは、約100% (図8 (a) p3) が透過する。 この光ピームは、光記録媒体46の記録面で反射され再 nmで最適化された1/4波長板44を2度透過してい るため偏光方向が約90°回転した楕円偏光 (P偏光に 近い楕円偏光)で入射する。この光ピームは、約100 % (図8 (a) p3) が偏光ビームスブリッタ43を透 過し、偏光ビームスプリッタ49にP偏光に近い楕円偏 光で入射する。偏光ビームスブリッタ49にP偏光に近 い楕円偏光で入射した光ピームは、わずかなS偏光は反 射されるが100%(図8(b)p6)近くの光ピーム が透過する。

> 【0053】上述のように1/4波長板44を挿入する ことにより、偏光ピームスプリッタ43及び偏光ピーム スプリッタ49に於ける損失を大幅に低減させることが できる。

[0054]

【発明の効果】本発明によれば、上記のように2つの光 源から出力される光ピームを1つの光検出器で受光する ようにしたので、光学ピックアップ装置の小型化及び低 コスト化を図ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の光学ピックアップ装置(無限系)の構 成を示した説明図である。

【図2】本発明の光学ピックアップ装置に用いた偏光ビ ームスプリッタの透過特性を示したグラフである。

【図3】光検出器に形成された受光素子の構成を示した 図面である。

【図4】受光素子の感度を示したグラフである。

【図5】光検出器に形成された受光素子の構成を示した 図面である。

【図6】本発明の光学ピックアップ装置(有限系)の構

【図7】本発明の光学ピックアップ装置 (無限系) の構 成を示した説明図である(1/4波長板を用いた場 合)。

【図8】本発明の光学ピックアップ装置に用いた偏光ビ ームスプリッタの透過特性を示したグラフである (1/ 4波長板を用いた場合)。

【図9】レンズの開口数を説明するための説明図であ る。

#### 【符号の説明】

1、6、31、35、41、47 レーザーダイオー

2、8、42、48 コリメータレンズ

3、9、32、36、42、48 偏光ピームスプリッ

4、33、45 対物レンズ

5、34、46 記録媒体

### 7 回折格子

10、50 集光レンズ

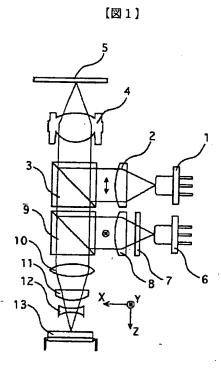
11、51 アナモフィックレンズ

12、52 凹レンズ

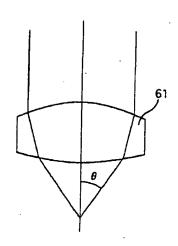
13、38、53 光検出器

10 37 複合レンズ

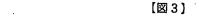
21、22、23、24、25、26、27 受光素子

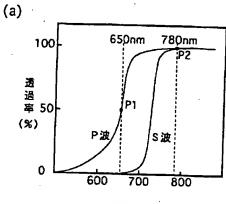


[図9]

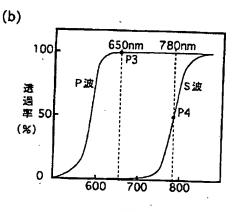


【図2】





波長 (nm)



波長 (nm)

